Ионизация в электрическом поле DX-центра, связанного с серой, в $In_{1-x}Ga_xP$

© Ю.К. Крутоголов¶

Научно-исследовательский институт материалов электронной техники, 248650 Калуга, Россия

(Получена 14 мая 2007 г. Принята к печати 18 июня 2007 г.)

С помощью нестационарной емкостной спектроскопии глубоких уровней и вольт-фарадных измерений исследовано влияние электрического поля на процесс ионизации *DX*-центра, связанного с серой, в слоях $In_{1-x}Ga_xP$ ($x \approx 0.65$) *n*-типа проводимости, выращенных методом газовой эпитаксии. Показано, что при увеличении напряженности электрического поля от $1.3 \cdot 10^4$ до $1.9 \cdot 10^5$ В/см энергия активации центра падает от ~ 0.38 до ~ 0.26 эВ, причем процесс ионизации определяется многофононным туннелированием. По оцененному значению времени туннелирования дефекта сделано заключение, что *DX*-центр соответствует модели большой релаксации решетки.

PACS: 61.72.Ji, 71.55.Eq

1. Введение

В течение многих лет особый интерес исследователей привлекают глубокие локализованные дефекты, называемые DX-центрами [1], которые приводят к явлению устойчивой фотопроводимости при пониженных температурах и принципиально неустранимы, так как образуются легирующими примесями. Основной проблемой, относящейся к свойствам DX-центров, является понимание механизма метастабильности этих дефектов. Наиболее распространена точка зрения, что метастабильность вызвана большой релаксацией решетки (LLR), следующей за захватом электрона DX-состоянием [1,2]. При этом дефект участвует в реакции "замещениевнедрение" [3,4]. Для стабилизации такой конфигурации атомов в решетке дефект должен захватить два электрона [4]. Следовательно, основное состояние DX-центра должно быть отрицательно заряженным и вся система должна обладать отрицательной корреляционной энергией U [5]. Существуют и альтернативные молели [2]. Так, в одной из работ [6] в противоположность модели [4] считают, что при образовании DX-центра происходит небольшая тетрагональная деформация решетки со смещением атомов V группы вокруг донорного атома IV группы. Однако и в этом случае дефект образует систему с отрицательной U. Таким образом, проблема микроскопической структуры DX-центров, а именно тип или симметрия релаксации решетки, является не вполне определенной.

Изучение влияния электрического поля на процесс ионизации центров с глубокими уровнями является важным инструментом, позволяющим проникнуть в природу дефектов в полупроводниках. Так, например, из полевых исследований можно получить информацию о зарядовом состоянии центра и пространственной протяженности потенциала дефекта, судить о типе релаксации решетки при перезарядке глубокого уровня [2,7]. При этом обычно анализируются эффекты Пула–Френкеля [8] и Штарка [9], многофононное [10,11] и прямое [12] туннелирование. С другой стороны, многие экспериментальные способы обнаружения и изучения глубоких центров, в частности стандартный метод — нестационарная емкостная спектроскопия глубоких уровней (DLTS), основаны на термической эмиссии носителей заряда из ловушек в пределах области пространственного заряда (ОПЗ) p-n-перехода или барьера Шоттки при обратном смещении, где неизбежно существует большое встроенное электрическое поле. Поэтому при идентификации глубоких центров необходимо учитывать возможность воздействия электрического поля на измеряемые параметры.

Однако информация о влиянии электрического поля на процесс ионизации DX-центров ограничена и противоречива [2]. Так, при исследовании методом DLTS слоев GaAs, легированного Si, при гидростатическом давлении с концентрацией примеси в [13] и [14], различающейся почти на 2 порядка величины, не обнаружено значительной разницы энергий термоэмиссии, несмотря на ожидаемое различие максимальной напряженности встроенного электрического поля. В [15] при использовании разновидностей метода изотермической релаксации емкости также наблюдалось отсутствие воздействия электрического поля на эмиссию из основного состояния DXцентра в Al_{0.55}Ga_{0.45}As, легированном Те. Отсутствие эффекта Пула-Френкеля согласуется с предположением о наличии у DX-центров отрицательной U, характерной для модели большой релаксации решетки [4], но не подтверждает его [2]. Напротив, в [16,17], применяя соответственно дифференциальный емкостной метод и двойной коррелированный метод DLTS (DDLTS), удалось обнаружить усиление электрическим полем термоэмиссии электронов из DX-центров в Al_{0.55}Ga_{0.45}As, легированном Те, и Al_{0.68}Ga_{0.32}As, легированном Sn. Более того, в [18,19] на основании DLTS-измерений утверждается, что ионизация DX-центров, связанных с теллуром в Al_{0.25}Ga_{0.75}As и с кремнием в In_{0.5}Ga_{0.5}P, даже в сильных электрических полях происходит посредством эффекта Пула-Френкеля. На этом основании

[¶] E-mail: krutogolov@mail.ru

в [18] делается вывод, что потенциал, связывающий электрон на *DX*-центре, не является короткодействующим, а DX-центр является одиночным донором, нейтральным в основном состоянии, происходящем из L-состояния эффективной массы, и ему соответствует модель малой релаксации решетки. В то же время в [20,21] при изучении ионизации глубоких центров дальним инфракрасным излучением показано, что в широком диапазоне электрических полей от слабых до сильных эмиссия носителей из DX-центров, связанных с теллуром в Al_{0.35}Ga_{0.65}As и в Al_{0.5}Ga_{0.5}Sb, определяется многофононным туннелированием. В результате ионизации DX-центр становится нейтральным, а время туннелирования характерно для перехода из автолокализованного состояния [20,21]. Таким образом, на основе указанных исследований делаются противоположные выводы о микроскопической структуре и свойствах DX-центров.

В настоящей работе изучено влияние электрического поля на процесс ионизации DX-центра, связанного с серой, в твердом растворе $In_{1-x}Ga_xP$, широко используемом для целей квантовой, опто- и наноэлектроники, солнечной фотоэнергетики [22]. Кроме того, сам по себе DX-центр, относящийся к сере, вызывает повышенный интерес в связи с теоретическим предсказанием [23], что в основном состоянии он должен обладать симметрией C_{2v} в отличие от типичных DX-центров, образованных другими элементами IV и VI групп в соединениях А^{III}В^V, которые, находясь в основном состоянии, характеризуются симметрией Сзи. Это предположение не согласуется с результатами работы [24], где на основе использования кластерного приближения делается вывод, что орторомбические искажения (C_{2n}) кристаллической структуры характерны для примесей, количество валентных электронов которых отличается от такового для замещаемого атома на четное число, а в случае нечетного числа более предпочтительным является тригональное искажение (C_{3v}) .

2. Образцы и методы измерений

Слои $In_{1-x}Ga_x P$ ($x \approx 0.65$) *п*-типа проводимости толщиной 10-15 мкм получались методом газовой эпитаксии в хлоридно-гидридной системе. Между эпитаксиальным слоем и подложкой *n*-GaP (100) выращивался переходный слой переменного состава с градиентом 1.5-2 мол%/мкм. Состав твердого раствора определялся на рентгеновском микроанализаторе MS-46 фирмы "Сатеса", концентрация Ga x измерялась с ошибкой меньше ±0.02 мол%, а изменение х в каждом образце не превышало 0.01 мол%. Легирование серой осуществлялось введением в реактор H₂S. Концентрация нескомпенсированных доноров, оцененная из вольтфарадных (C-V) измерений, находилась в диапазоне $(0.8-1.2) \cdot 10^{17} \, \text{см}^{-3}$. Фоновыми примесями в данной эпитаксиальной системе обычно являются кремний и сера. В отобранных для настоящего исследования слоях концентрация фонового кремния, измеренная на ионном

микроанализаторе IMS-3F фирмы "Сатеса" методом вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС), была ниже $1 \cdot 10^{16}$ см⁻³. DLTS- и *C*–*V*-измерения проводились на барьерах Шоттки, изготовленных вакуумным осаждением золота. Омические контакты к подложечной стороне структур создавались распылением олова в электрическом разряде.

Спектры DLTS $\Delta C(T)$ формировали модернизированным спектрометром в диапазоне температур T = 78-400 К [25]. Для получения зависимости скорости эмиссии электронов (e_n) и энергии активации глубокого центра (E_a) от электрического поля была использована модификация метода DDLTS, аналогичная применявшейся в [18]. Для исключения влияния на результаты измерения вымораживания носителей на *DX*-центры в электронейтральной области слоев "окна скорости эмиссии" выбирали так, чтобы пики в спектрах DDLTS находились в стороне от области вымораживания, учитывая предостережения, высказанные в [15].

3. Результаты и их обсуждение

Во всех исследованных образцах в изученном диапазоне температур методом DLTS обнаружен только один тип электронных ловушек с заметной концентрацией. Ранее было установлено [26], что амплитуда пика в спектрах DLTS данных ловушек линейно возрастала с увеличением концентрации атомов S, измеренной методом ВИМС, в широком диапазоне легирования. Это указывало на связь обнаруженных ловушек с S. Принадлежность электронной ловушки к DX-центру подтверждалась наличием долговременной фотоемкости при низких температурах, соответствием между концентрацией ловушек, ответственных за долговременную фотоемкость, и оцененной методом DLTS, а также существенным различием термической и оптической энергий активации электронной эмиссии [27].

Для выбранных значений напряженности электрического поля E в достигнутом диапазоне от $\sim 1 \cdot 10^4$ до $\sim 2 \cdot 10^5$ В/см определены спектры DDLTS для различных "окон скорости эмиссии", по которым получены графики Аррениуса для обратной скорости эмиссии электронов, скорректированной на квадрат температуры (T^2) пика в спектре DDLTS. Графики Аррениуса для трех средних значений E представлены на рис. 1. Там же на вставке показаны типичные спектры DDLTS.

Для выяснения механизма ионизации глубокого центра из графиков Аррениуса, построенных для различных значений E, определены зависимости e_n от E. В [21] подчеркивается, что эмиссия Пула–Френкеля и многофононное туннелирование являются двумя конкурирующими механизмами увеличения скорости ионизации центра и что эти модели могут быть распознаны по экспоненциальной зависимости e_n от \sqrt{E} или E^2 соответственно. Однако, как показано в [9], экспоненциальная зависимость e_n от E^2 будет наблюдаться и в случае квадратичного эффекта Штарка на глубоком центре вследствие



Рис. 1. Графики Аррениуса для *DX*-центров, связанных с серой в InGaP, соответствующие трем средним значениям напряженности электрического поля в тонком слое ОПЗ *E*, 10^5 B/cm: 1 - 0.2, 2 - 1, 3 - 2. На вставке — спектры DDLTS *DX*-центров при длительности импульса заполнения 0.1 мс, "окне скорости эмиссии" 69.3 с⁻¹ и средних значениях напряженности электрического поля *E*, 10^5 B/cm: 1 - 0.2, 2 - 2.



Рис. 2. Зависимости логарифма скорости эмиссии электронов из *DX*-центров, связанных с серой, от квадрата средней напряженности электрического поля в тонком слое ОПЗ барьера Шоттки Au–InGaP при различных температурах. Экспериментальные точки взяты из графиков Аррениуса, прямые построены с использованием метода наименыших квадратов.

относительного смещения адиабатических потенциалов различных зарядовых состояний дефекта. Полученные нами экспериментальные данные для четырех значений температур из диапазона измерения не укладываются на линейную зависимость $\ln e_n$ от \sqrt{E} , но хорошо подгоняются методом наименьших квадратов, как показано на

рис. 2, в логарифмическом масштабе к прямой линии, описываемой уравнением [9,11]

$$e_n(E) = e_n(0) \exp\left(\frac{E^2}{E_c^2}\right),\tag{1}$$

где $e_n(0)$ — скорость эмиссии электронов в отсутствие электрического поля, E_c — характеристическое поле, задаваемое в случае многофононного туннелирования выражением [11]

$$E_c = \sqrt{\frac{3m^*\hbar}{e^2\tau_2^3}}.$$
 (2)

Здесь m^* — эффективная масса носителей заряда, \hbar — постоянная Планка, e — заряд электрона, τ_2 — время туннелирования дефекта в конфигурационном пространстве под адиабатическим потенциалом, соответствующим дефекту без электрона, при оптимальной энергии термоактивированного туннелирования. Температурная зависимость τ_2 задается как

$$\tau_2 = \frac{\hbar}{2kT} \pm \tau_1, \tag{3}$$

где k — постоянная Больцмана, τ_1 — постоянная времени, по порядку величины равная обратной частоте колебаний локализованной примеси, знаки «+» и «-» соответствуют структурам адиабатических потенциалов для случаев слабой и сильной электрон-фононной связи, характерных для примесей замещения и автолокализованных центров соответственно [7].

Хорошее соответствие зависимости $\ln e_n$ от E^2 прямой линии показывает, что в диапазоне напряженности электрического поля от $1.3 \cdot 10^4$ до $1.9 \cdot 10^5$ В/см ионизация DX-центра определяется не эффектом Пула–Френкеля, а многофононным туннелированием или квадратичным эффектом Штарка. Следует отметить, что многофононное туннелирование, как и эффект Пула-Френкеля, являясь по сути механизмом ионизации, по-видимому, мало чувствительно к симметрии дефекта и ориентации поля относительно кристаллографических направлений. Другое дело — эффект Штарка в кристалле. Электрическое поле вызывает смещение двухэлектронных адиабатических потенциалов заряженных состояний [28]. Если DX-центр, находясь в основном состоянии, характеризуется симметрией C_{3v} [4], то экспериментально наблюдаемый (результирующий) пик в спектре DDLTS должен состоять из двух групп по четыре пика, что хорошо проявляется в спектрах DLTS с преобразованием Лапласа [29]. Каждый из составляющих пиков образуется в результате ионизации DX-центра со смещением одного из атомов III группы (Ga или In в данном случае), ближайшего к донорной примеси VI группы (S в данном случае), из тригонального межузельного положения вдоль одного из четырех эквивалентных направлений типа (111) в тетраэдрическое состояние замещения (*T*_d-симметрия). Эти составляющие пики, накладываясь друг на друга,

образуют в отсутствие поля общий результирующий пик, структуру которого трудно различить при использовании стандартного метода DLTS. При наличии электрического поля в направлении (100) следует ожидать, что каждая группа составляющих пиков расщепится на две подгруппы, одна из которых соответствует смещению адиабатических потенциалов заряженных состояний из фиксированного межузельного положения C_{3v} по направлению к T_d-состоянию замещения, а другая в противоположную сторону. Таким образом, электрическое поле должно оказывать как стимулирующее, так и тормозящее воздействие на переход DX-центра в метастабильное состояние, аналогично рассмотренному в [30] для *EL2*-центра в GaAs. Это должно привести к расщеплению результирующего пика в спектре DDLTS на два или по крайней мере к его уширению при соответствующем уменьшении амплитуды. В случае, если DX-центр, связанный с серой, обладает C_{2v} -симметрией, как предсказывается в [23], то результирующий пик в спектре DDLTS, образующийся при ионизации DX-центров, может состоять, по-видимому, из еще большего числа пиков. Действительно, каждый составляющий пик должен соответствовать смещению атома S из орторомбического межузельного положения вдоль одного из шести эквивалентных направлений типа (100) в *Т*_d-состояние замещения при одновременном смещении двух соседних атомов III группы (Ga и/или In) в плоскости, перпендикулярной указанному направлению. Эти составляющие пики накладываются друг на друга, образуя в отсутствие поля общий результирующий пик в спектре DDLTS. При наличии электрического поля в направлении (100) следует ожидать, что треть составляющих пиков расщепится на две группы, одна из которых соответствует смещению адиабатических потенциалов заряженных состояний из фиксированного межузельного положения C_{2v} по направлению к тетраэдрическому состоянию замещения, а другая — в противоположную сторону. Остальные две трети пиков, соответствующие движению атомов серы в плоскости (100), в рассматриваемом случае, по-видимому, не должны существенно смещаться по температурной шкале. Это может привести к уширению результирующего пика в спектре DDLTS при соответствующем уменьшении его амплитуды. Все эти рассуждения основываются на предположении равной вероятности распределения DX-центров по эквивалентным направлениям в кристалле. В результате для пиков в спектре DDLTS, соответствующих DX-центрам, обладающим C_{3v} - и C_{2v} -симметрией, должно происходить уширение, хотя и несколько различающееся (возможно, более сильное для C_{3v} -симметрии), при соответствующем уменьшении их амплитуды. Повидимому, именно это и наблюдается в эксперименте, как показано на вставке к рис. 1. Следовательно, ожидать существенного смещения по температурной шкале максимума экспериментально наблюдаемых пиков в спектре DDLTS в результате действия эффекта Штарка в рассматриваемом случае не приходится из-за недостаточной разрешающей способности метода DLTS.



Рис. 3. Зависимость времени туннелирования τ_2 от обратной температуры для *DX*-центров, связанных с серой в InGaP. Штриховая прямая соответствует $\tau_2 = \hbar/2kT$, сплошная линия $\tau_2 = \hbar/2kT - \tau_1$ при $\tau_1 \approx 1 \cdot 10^{-14}$ с.

Наклон зависимостей $\ln e_n$ от E^2 в соответствии с уравнением (1) позволяет определить характеристическое поле Е. По величине Е. для четырех температур в диапазоне от 125 до 140 К с использованием выражения (2) оценены времена туннелирования τ_2 , представленные на рис. 3. Там же штриховой линией показана температурная зависимость $\hbar/2kT$, а сплошной линией — параллельная ей прямая, совмещенная с экспериментальными точками. Как видно из рисунка, время туннелирования τ_2 хорошо может быть описано формулой (3) при постоянной времени $\tau_1 \approx 1 \cdot 10^{-14} \,\mathrm{c}$ и знаке «-». Последнее указывает на то, что DX-центр соответствует модели большой релаксации решетки [4]; это согласуется с результатами работ [20,21], но противоречит выводам работ [18,19]. Следует отметить, что в последних упомянутых работах результаты получены лишь для особых составов твердых растворов, соответствующих выходу DX-уровня из зоны проводимости в запрещенную зону, а для других составов, где DX-центр должен находиться в стабильном состоянии, эффект Пула-Френкеля не обнаружен. На рис. 4 точками показаны экспериментальные значения энергии активации E_a DX-центров, связанных с S, в зависимости от напряженности электрического поля. По этим данным рассчитано уменьшение энергии активации термической эмиссии электронов:

$$\Delta E_a(E) = E_a(0) - E_a(E), \qquad (4)$$

где $E_a(0)$ — энергия активации при напряженности поля, равной нулю. Как и следовало ожидать для многофононного туннелирования, представленные на рис. 5 результаты расчета удовлетворительно описываются линейной зависимостью ΔE_a от E^2 (прямая построена по методу наименьших квадратов). При этом следует отметить, что результаты расчета не укладываются на линейную зависимость ΔE_a от \sqrt{E} (не показанную здесь), характерную для эффекта Пула–Френкеля. Действительно, как отмечено в [11,12], существует оптимальная энергия, с которой вылетает электрон при



Рис. 4. Энергия активации эмиссии электронов из DXцентров, связанных с серой, в зависимости от среднего значения напряженности электрического поля в тонком слое ОПЗ: I — экспериментальные данные, (2-4) — зависимости, рассчитанные с использованием формул (4) и (5) для температур 125, 130 и 135 К соответственно.



Рис. 5. Зависимость уменьшения энергии активации термической эмиссии электронов из DX-центров, связанных с серой, от квадрата средней напряженности электрического поля в тонком слое ОПЗ, рассчитанная по данным рис. 4 и $E_a(0) \approx 0.38$ эВ. Прямая построена с использованием метода наименьших квадратов.

многофононном туннелировании:

$$\varepsilon_m = \frac{\tau_2^2 e^2 E^2}{2m^*}.$$
 (5)

Эта отрицательная энергия отсчитывается от нулевого уровня энергии [20] и соответствует ΔE_a . Поэтому, как следует из (5), для ΔE_a также нужно ожидать линейную зависимость от E^2 , что и подтверждается данными рис. 5 в диапазоне напряженности электрического

поля от $1.3 \cdot 10^4$ до $1.9 \cdot 10^5$ В/см. К сожалению, для $E < 1 \cdot 10^4$ В/см использованный здесь метод не может быть применен из-за ограниченной чувствительности. Однако в [20] на примере AlGaAs, легированного теллуром, показано, что даже в области низких полей эмиссия из *DX*-центра описывается многофононным туннелированием. На этом основании и в предположении, что зависимость ΔE_a от E^2 в области низких полей линейна, отрезок прямой, полученный на рис. 5 для указанного выше диапазона электрических полей, экстраполирован вплоть до E = 0. Подбором $E_a(0)$ таким образом, чтобы $\Delta E_a(0) = 0$, оценено значение энергии активации эмиссии электронов для *DX*-центра, связанного с серой в In_{0.35}Ga_{0.65}P, при нулевой напряженности электрического поля, которое оказалось равным ~ 0.38 эВ.

Как показано на рис. 4, рассчитанные при использовании формул (4) и (5) зависимости энергии активации многофононного туннелирования от напряженности электрического поля для трех температур из диапазона измерения удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. Отсутствие значительной полевой зависимости энергии термоэмиссии в [13,14], возможно, связано с тем, что средние значения напряженности электрического поля, которые можно реализовать при использовании метода DLTS, приходятся на диапазон, где сильная полевая зависимость скорости эмиссии и энергии ионизации еще отсутствует.

К сожалению, поскольку многофононное туннелирование может происходить как для заряженных, так и для нейтральных центров, сделать вывод о зарядовом состоянии дефекта до и после ионизации по нашим экспериментальным данным не представляется возможным.

4. Заключение

В слоях $In_{1-x}Ga_x P$ ($x \approx 0.65$) *п*-типа проводимости энергия активации *DX*-центра, связанного с серой, уменьшается от ~ 0.38 до ~ 0.26 эВ при увеличении напряженности электрического поля от $1.3 \cdot 10^4$ до $1.9 \cdot 10^5$ В/см, что необходимо учитывать при идентификации ловушек. В указанном диапазоне электрических полей процесс ионизации центра определяется многофононным туннелированием. Значение времени туннелирования дефекта подтверждает, что *DX*-центр соответствует модели большой релаксации решетки.

Автор выражает благодарность Е.Н. Корсакову и С.Н. Ремезову за помощь в измерениях, Ю.И. Кунакину и А.А. Матяшу за поддержку.

Список литературы

- D.V. Lang. In: *Deep Centers in Semiconductors*, ed. by S.T. Pantelides (N.Y., Gordon and Breach Science Publisher, 1986) p. 489.
- [2] P.M. Mooney. J. Appl. Phys., 67, R1 (1990).
- [3] T.N. Morgan. Phys. Rev. B, 34, 2664 (1986).

- [4] D.J. Chadi, K.J. Chang. Phys. Rev. B, 39, 10063 (1989).
- [5] P.W. Anderson. Phys. Rev. Lett., 34, 953 (1975).
- [6] S.W. Biernacki. Sol. St. Commun., 98, 863 (1996).
- [7] В.Н. Абакумов, В.И. Перель, И.Н. Яссиевич. Безызлучательная рекомбинация в полупроводниках (СПб., Изд-во ПИЯФ РАН, 1997).
- [8] А. Милнс. Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках (М., Мир, 1977).
- [9] Н.Т. Баграев, Н.М. Колчанова, В.А. Машков. Письма ЖЭТФ, 45, 231 (1987).
- [10] S. Markram-Ebeid, M. Lannoo. Phys. Rev. B, 25, 6406 (1982).
- [11] В. Карпус, В.И. Перель. ЖЭТФ, 91, 2319 (1986).
- [12] Ж. Бургуэн, М. Ланно. Точечные дефекты в полупроводниках. Экспериментальные аспекты (М., Мир, 1985).
- [13] M. Mizuta, M. Tachikawa, H. Kukimito, S. Minomura. Jpn. J. Appl. Phys., 24, L143 (1985).
- [14] T.N. Theis, P.M. Mooney, S.L. Wright. Phys. Rev. Lett., 60, 361 (1988).
- [15] L. Dobaczewski, J.E. Dmochowski, J.M. Langer. Semicond. Sci. Technol., 6, 752 (1991).
- [16] J.R. Morante, J. Samitier, A. Cornet, A. Herms. Appl. Phys. Lett., 45, 1317 (1984).
- [17] I.D. Hwang, B. Choe. Jpn. J. Appl. Phys., 25, L891 (1986).
- [18] M. Zazoui, S.L. Feng, J.C. Bourgoin. Semicond. Sci. Technol., 6, 973 (1991).
- [19] J. Krynicki, M.A. Zaidi, M. Zazoui, J.C. Bourgoin, M. DiForte-Poisson, C. Brylinski, S.L. Delage, H. Blank. J. Appl. Phys., 74, 260 (1993).
- [20] С.Д. Ганичев, И.Н. Яссиевич, В. Преттл. ФТТ, 39, 1905 (1997).
- [21] S.D. Ganichev, E. Ziemann, W. Prettl, I.N. Yassievich, A.A. Istratov, E.R. Weber. Phys. Rev. B, 61, 10361 (2000).
- [22] Ж.И. Алфёров, В.М. Андреев, В.Д. Румянцев. ФТП, 38, 937 (2004).
- [23] C.H. Park, D.J. Chadi. Phys. Rev. B, 54, R14 246 (1996).
- [24] Д.Е. Онопко, Н.Т. Баграев, А.И. Рыскин. ФТТ, 37, 2376 (1995).
- [25] A.V. Skazochkin, Yu.K. Krutogolov, G.G. Bondarenko. Semicond. Sci. Technol., 11, 495 (1996).
- [26] Ю.К. Крутоголов, В.Л. Крюков, Ю.И. Кунакин, А.А. Матяш, А.К. Горбунов. Поверхность, № 12, 61 (2004).
- [27] Yu.K. Krutogolov, Yu.I. Kunakin, A.A. Matyash. J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 12, 645 (2001).
- [28] N.T. Bagraev. Sol. St. Commun., 95, 365 (1995).
- [29] L. Dobaczewski, P. Kaczor, M. Missous, A.R. Peaker, Z.R. Zytkiewicz. Phys. Rev. Lett., 68, 2508 (1992).
- [30] Н.Т. Баграев. ЖЭТФ, 100, 1378 (1991).

Редактор Л.В. Шаронова

lonization in electric field of S-related DX center in $In_{1-x}Ga_xP$

Yu.K. Krutogolov

Scientific and Research Institute of Electronic Engineering Materials, 248650 Kaluga, Russia

Abstract Electric field effect on sulphur-related *DX* center ionization process in *n*-type $In_{1-x}Ga_xP$ ($x \approx 0.65$) layers grown by vapor phase epitaxy was investigated by deep level transient spectroscopy and capacitance–voltage measurements. It was shown while increasing electric field intensity from $1.3 \cdot 10^4$ to $1.9 \cdot 10^5$ V/cm activation energy reduced from ~ 0.38 to ~ 0.26 eV, with ionization process is dominated by phononassisted tunneling. From the estimated tunnelling time value it was concluded that *DX* center corresponds with the model of large lattice relaxation.